

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】令和 4 年 12 月 13 日(2022.12.13)

【公開番号】特開 2022-54974(P2022-54974A)
 【公開日】令和 4 年 4 月 7 日(2022.4.7)
 【年通号数】公開公報(特許)2022-062
 【出願番号】特願 2020-162284(P2020-162284)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 23/20025(2018.01)

10

H 0 1 M 10/48(2006.01)

H 0 1 M 10/052(2010.01)

H 0 1 M 10/0562(2010.01)

H 0 1 M 10/0585(2010.01)

【F I】

G 0 1 N 23/20025

H 0 1 M 10/48 A

H 0 1 M 10/052

H 0 1 M 10/0562

H 0 1 M 10/0585

20

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 11 月 30 日(2022.11.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

一方の端面が前記試料室に配置した試料の一端面に接触し、かつ他方の端面が前記圧受け部に接触する圧受け部材を、前記試料室内に有することを特徴とする請求項 5 に記載の加圧分析用構造体。

30

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

ここで、一方の端面が試料室に配置した試料の一端面に接触し、かつ他方の端面が圧受け部に接触する圧受け部材を、試料室内に有する構成とすることが好ましい。これにより、試料の外면을 X 線窓と対して露出させ、当該試料の外面に X 線を照射することが可能となる。

40